

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Афанасьев А.М., Имамов Р.М.</i> О механизмах генерации вторичных излучений в методе стоячих рентгеновских волн	3
<i>Валиев К.А., Васильев А.Г., Васильев А.Л., Головин А.А., Имамов Р.М., Киселев Н.А., Орликовский А.А., Седельников А.Э.</i> Структура и свойства пленок $TiSi_2$ и границы раздела $TiSi_2/Si$	22
<i>Антонов С.Л., Васильев А.Г., Орликовский А.А., Седельников А.Э.</i> Процессы физического распыления и анализ методами вторичной масс-спектрометрии и нонно-фотонной спектроскопии пленок дисилицида титана	38
<i>Абачев М.К., Барышев Ю.П., Валиев К.А., Лукичев В.Ф., Орликовский А.А.</i> Формирование профиля при плазмохимическом травлении глубоких щелей в кремнии	49
<i>Бунэ Ан.В., Валиев К.А., Махвиладзе Т.М.</i> Математическое моделирование процесса планаризации рельефных микроструктур	66
<i>Валиев К.А., Махвиладзе Т.М., Сарычев М.Е.</i> Миграционная модель кинетики отказов, возникающих под действием электрических полей и механических напряжений	73
<i>Манькин Э.А., Белов М.Н., Евсин О.А., Мухин И.С., Петренко Е.А., Селифанов М.А., Чернышев Н.А., Шаббаев Е.С., Шахпаронов И.М.</i> Некоторые особенности фотонного эха в $LaF_3 : Pr^{3+}$ и принципы оптического эхо-процессинга	84
<i>Баннов Н.А., Хренов Г.Ю.</i> Трансформация электрических характеристик арсенид-галлиевых ПТШ при масштабном изменении конструктивных параметров	106

CONTENTS

<i>Afanas'ev A.M., Imamov R.M.</i> On the secondary radiation generation in the standing X-ray waves method	3
<i>Valiev K.A., Vasil'ev A.G., Vasil'ev A.L., Golovin A.A., Imamov R.M., Kiselev N.A., Orlikovsky A.A., Sedelnikov A.E.</i> Structure and properties of $TiSi_2$ films and $TiSi_2/Si$ interface	22
<i>Antonov S.L., Vasil'ev A.G., Orlikovsky A.A., Sedelnikov A.E.</i> Physical sputtering processes and SIMS and IPS analysis of titanium disilicide films	38
<i>Abachev M.K., Baryshev Yu.P., Valiev K.A., Lukichev V.F., Orlykovsky A.A.</i> Profile formation in the plasma-chemical etching of deep trenches in silicon	49
<i>Bune An.V., Valiev K.A., Makhviladze T.M.</i> Mathematical modeling of relief microstructure planarization process	66
<i>Valiev K.A., Makhviladze T.M., Sarychev M.E.</i> Migration model of kinetics of failures caused by electric field and mechanical tensions	73
<i>Manykin E.A., Belov M.N., Evsin O.A., Mukhin I.S., Petrenko E.A., Selifanov M.A., Chernyshov N.A., Shabaev E.S., Shachparonov I.M.</i> Some peculiarities of photon echo in $LaF_3 : Pr^{3+}$ and optical echo-processing principles	84
<i>Bannov N.A., Khrenov G.Yu.</i> Gallium-arsenide MESFET electrical characteristics transformation for scaled changing of constructive parameters	106